

A. 真空工学コース

講義 (定員 20 名)

日程	講義室	9:50 ~ 11:50	12:50 ~ 14:50	15:00 ~ 17:00
10月6日(金)	山口大学 VBL 3階セミナー室	気体分子運動論 1	気体分子の流れ	気体分子運動論 2
10月7日(土)		真空ポンプと排気系 1	真空ポンプと排気系 2	真空計測
10月13日(金)		真空部品と可動機構	真空材料とガス放出	真空装置用表面処理
10月14日(土)		真空と表面	表面と分子の相互作用	吸着平衡と脱離過程

実習 (定員 5 名)

日程	実習室	8:40 ~ 10:10	10:20 ~ 11:50	12:50 ~ 14:20	14:30 ~ 16:00	16:10 ~ 17:40
10月21日(土)	山口大学工学部 中核人材実習室	真空工学実習				

B. 真空プロセスコース

講義 (定員 20 名)

日程	講義室	9:50 ~ 11:50	12:50 ~ 14:50	15:00 ~ 17:00
10月27日(金)	山口大学 VBL 3階セミナー室	真空プロセス技術の概要	PVD 1 原理と装置構造	PVD 2 原理と装置構造
10月28日(土)		PVD 3 / CVD 1 原理と装置構造	CVD 2 原理と装置構造	PVD 4 / CVD 3 デバイス応用と技術動向
11月10日(金)			表面改質・焼結技術 (1)	表面改質・焼結技術 (2)
11月11日(土)		評価と計測 - 薄膜材料評価 -	デバイス開発のための 表面・界面分析技術 1	デバイス開発のための 表面・界面分析技術 2

実習(定員 5 名)

日程	実習室	8:40 ~ 10:10	10:20 ~ 11:50	12:50 ~ 14:20	14:30 ~ 16:00	16:10 ~ 17:40
11月17日(金)	山口大学工学部 中核人材実習室	薄膜形成関連実習				
11月17日(金)	山口県 産業技術センター (2 コース同時開催)	12:50 ~ 14:20	14:30 ~ 16:00	16:10 ~ 17:40		
		焼結関連実習 (常圧焼結に関する実習)				
11月18日(土)		焼結関連実習 (放電プラズマ焼結に関する実習)				
		12:50 ~ 14:20	14:30 ~ 16:00	16:10 ~ 17:40		
焼結材料・薄膜評価実習 (電子顕微鏡に関する実習)						
焼結材料・薄膜評価実習 (蛍光 X 線分析に関する実習)						

C. マイクロ加工コース

講義 (定員 20 名)

日程	講義室	9:50 ~ 11:50	12:50 ~ 14:50	15:00 ~ 17:00
11月24日(金)	山口大学 VBL 3階セミナー室	高加工精度化	精密加工評価技術	精密加工の概要と技術動向 超平滑加工とナノ加工
11月25日(土)		微細加工工程の概要と 技術動向	リソグラフィ技術 1	リソグラフィ技術 2
12月1日(金)			エッチング手法と 技術動向	ドライエッチング技術
12月2日(土)		ドライエッチングの基礎 1 - プラズマ -	ドライエッチングの基礎 2 - エッチング特性 -	エッチング精度と歩留まり

実習(定員 5 名)

日程	実習室	8:40 ~ 10:10	10:20 ~ 11:50	12:50 ~ 14:20	14:30 ~ 16:00	16:10 ~ 17:40
12月15日(金)	山口大学 V B L 1 階 クリーンルーム	リソグラフィ実習				
12月16日(土)		エッチング実習				
		12:50 ~ 14:20	14:30 ~ 16:00	16:10 ~ 17:40		
12月8日(金)	山口県 産業技術センター	精密加工実習				
12月9日(土)		精密加工実習				

* 各講義は、90分の講義と30分の質問及び講義内容、方法等についての意見交換の時間構成としております

* 各実習の最後に聴講生との質問及び実習内容、方法等についての意見交換を予定しております